

СОДЕРЖАНИЕ

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ОПТИКЕ

Белозеров А.Ф., Луккин А.В., Штырков Е.И. Казанская школа голографии	3
Полесский А.В., Соломонова Н.А., Семенченко Н.А., Храбров П.В. Оценка погрешности измерения спектральной характеристики чувствительности фотоприемников на основе InGaAs	20
Козлов К.В., Хамидуллин К.А. Моделирование влияния фотоэлектрической связи на дальность работы оптико-электронных систем	28

РАСЧЕТ, ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО ОПТИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Малькин А.А., Фуфурин Л.В., Шмидт А.И. Разработка объективов для телевизионных камер и приборов ночного видения с применением ограниченной номенклатуры марок стёкол	35
Кузнецов С.А., Немтинов В.Б., Сериков В.Ю. Структура и качество процесса преобразования сигналов в оптико- и лазерно-электронной системе	39
Шапиро Б.Л., Сухачев А.Б., Перчаткин Н.А., Державин Д.С., Никитин Н. Ю. Формирование структуры протокола информационного взаимодействия между оптико-электронной и бортовой системами с использованием определений общей теории систем	55
Карпов В.В., Козырев М.Е., Кузнецов Н.С., Марущенко А.В. Охлаждаемые фотоприемные устройства для дистанционного зондирования земли	62
Карев П.В. Миниатюрные пьезоэлектрические механизмы для электрооптических и космических применений	67

ОПТИЧЕСКОЕ ПРИБОРОСТРОЕНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ

Калипина Ю.А., Крехова Е.Ю., Поздняков А.Е. Организация производственного контроля лучевой прочности оптических материалов и покрытий на лазерной установке с наносекундной длительностью излучения.....	73
Понин О.В., Селиверстова Ю.О., Шаров А.А. Особенности юстировки внеосевого телескопа типа Мерсенна	82
Горелик Б.Д., Рычков А.С. Вопросы теории получения сверхгладких поверхностей оптических деталей	86

ОПТИЧЕСКОЕ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ

Митрофанова Ю.С., Санникова И.М., Сенник Б.Н.

Технологические особенности изготовления сегментированных внеосевых оптических элементов 97

Тимофеев О.В., Леонов Е.С.

Формообразование плоских и сферических поверхностей в процессе механической обработки оптических элементов на основе поликристаллического CVD ZnSe с последующим нанесением покрытий 101

Новиков В.П., Гаврищук Е.М., Мазавин С.М.,

Тимофеев О.В.

Крупногабаритный мультиспектральный материал селенида цинка, полученным методом CVD для диапазона 0,5 – 14 микрон 109

ИНФОРМАЦИЯ

Выдающийся деятель оптической промышленности 114

К юбилею Пелиха С.А. 116

Пелих С.А.

Основы монетарной политики Республики Беларусь в современных условиях 117

Майков Б.П.

Памяти Генерального конструктора оптических систем Виктора Васильевича Некрасова 120

Требования к публикациям в журнале «Контенант» 121